

الگوریتمی برای تعیین پارامترهای سیمپیج و بانک خازن با استفاده از روش اجزاء محدود با هدف به کارگیری در فرآیند شکلدهی الکترومغناطیسی

مهرداد خاندانی^۱، محمد صدیقی*

^۲- تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مکانیک

(تاریخ وصول: ۸۷/۱۰/۱۵، تاریخ پذیرش: ۸۸/۲/۱۳)

چکیده

تعیین پارامترهای سیمپیج و بانک خازن در فرآیند شکلدهی الکترومغناطیسی، یکی از مشکلات کاربردی این فرآیند محسوب می‌گردد. در این مقاله، الگوریتمی برای محاسبه شدت جریان پالسی دستگاه به ازاء پارامترهای مختلف سیمپیج و بانک خازن ارائه می‌گردد. در این روش ابتدا یک حدس اولیه برای فرکانس زاویه‌ای جریان و مشخصات بانک خازن در نظر گرفته می‌شود. سپس با استفاده از روش اجزاء محدود و یک حلقه تکرار محاسباتی، مشخصات دقیق پخش مؤثر پالس جریان به دست می‌آید. در این مقاله مسئله انساط الکترومغناطیسی استوانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج تجربی گرفته شده از مراجع مقایسه می‌گردد. این مقایسه انتباط قابل قبولی را بین نتایج محاسبه شده و تجربی نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: شکلدهی الکترومغناطیسی، انساط استوانه، بانک خازن، سیمپیج، روش اجزاء محدود.

تحلیل انواع فرآیندهای شکلدهی فلزات و استخراج نیروهای مورد نیاز آنها می‌کند. فرآیند شکلدهی الکترومغناطیسی ورق‌های فلزی یکی از فرآیندهای شکلدهی ورق با نرخ کرنش بالاست که نیروی مورد نیاز آن توسط یک پالس مغناطیسی تأمین می‌گردد. این فرآیند به سه شکل انساط استوانه‌های فلزی، انقباض استوانه‌های فلزی و شکلدهی ورق‌های تخت در صنعت انجام می‌پذیرد. در گذشته، پیچیدگی‌های فیزیکی این فرآیند همواره مانع بر سر

۱. مقدمه

در طراحی تمام فرآیندهای شکلدهی فلزات، نیاز به روش‌هایی داریم که تغییرشکل نهایی قطعه کار را به مشخصات مورد نیاز سیستمی که نیروی وارد بر آن را تأمین می‌کند ارتباط دهد. به این منظور در بسیاری از فرآیندهای سنتی شکلدهی فلزات، روابط تحلیلی ساده سازی شده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. به علاوه، امروزه شبیه‌سازی اجزاء محدود نیز کمک شایانی به

* E-mail: sedighi@iust.ac.ir

۱- دانشجوی دکتری
۲- دانشیار

قرار گیرد. به عنوان نمونه‌ای از فرآیند شکل دهنی الکترومغناطیسی، فرآیند انبساط الکترومغناطیسی استوانه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. به منظور اعتبار سنجی نتایج، یک مسئله انبساط الکترومغناطیسی استوانه که قبلاً در مرجع [۷] به صورت تجربی بررسی شده است، شبیه‌سازی شده و بخش مؤثر پالس جریان الکتریکی آن به دست می‌آید.

۲. تعیین پارامترهای دستگاه در فرآیند شکل دهنی الکترومغناطیسی

در این بخش ابتدا فرآیند شکل دهنی الکترومغناطیسی معرفی شده و سپس با ارائه تحلیل مداری فرآیند، چگونگی تعیین پارامترهای مداری دستگاه و اهمیت بهره‌گیری از ضریب خودالقائی معادل سیمپیج و قطعه کار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۱- معرفی فرآیند

در فرآیند شکل دهنی الکترومغناطیسی، قطعه کار فلزی توسط نیروی حاصل از یک پالس مغناطیسی، با سرعت زیاد تغییرشکل می‌دهد. اجزاء اصلی مدار دستگاه شکل دهنی الکترومغناطیسی شامل بانک خازن، منبع تأمین کننده ولتاژ، سیمپیج و سوئیچ تخلیه می‌باشد. شکل ۱ طرح شماتیکی از دستگاه فرآیند انبساط الکترومغناطیسی استوانه فلزی را نشان می‌دهد. در ابتداء، بانک خازن در اتصال سری با یک منبع تأمین ولتاژ قرار گرفته و با ولتاژ مناسب شارژ می‌شود. پس از کامل شدن شارژ با ولتاژ مورد نظر، سوئیچ ۱ باز شده و بانک خازن در مدار دستگاه شکل دهنی الکترومغناطیسی قرار می‌گیرد. سپس با بسته شدن سوئیچ ۲، یک پالس جریان سینوسی میرا شوند، با دامنه دهها کیلو ولت و فرکانس دهها کیلو هرتز در مدار جاری می‌گردد. عبور این پالس جریان سریع از سیمپیج موجب شکل گیری میدان مغناطیسی قدرتمندی در محیط پیرامون سیمپیج می‌شود. فرکانس این میدان مغناطیسی با فرکانس پالس جریان الکتریکی برابر بوده و همزمان با پالس جریان الکتریکی میرا می‌شود. بر اساس قانون القاء فاراده، اعمال این پالس مغناطیسی به قطعه کار، توزیع پیوسته‌ای از جریان گردابی را در قطعه کار القاء می‌نماید. جریان گردابی القاء شده در قطعه کار نیز یک میدان مغناطیسی را در اطراف خود ایجاد می‌نماید. جهت برداری این میدان توسط قانون مداری آمپر تعیین می‌گردد. در نهایت، اثر متقابل دو میدان مغناطیسی حاصل از سیمپیج و قطعه کار موجب شکل گیری نیروهای قدرتمند لورنتس در قطعه کار و لذا تغییرشکل سریع آن در جهت دور شدن از سیمپیج می‌شود.

راه توسعه صنعتی آن بوده است. در سال‌های اخیر محققین متعددی در جهت شبیه‌سازی اجزاء محدود این فرآیند تلاش کرده‌اند. فنتون^۱ [۱] از کد تفاضل محدود دوبعدی CALE که دارای قابلیت ALE است، برای شبیه‌سازی کوپله شکل دهنی آزاد یک ورق تخت و گرد استفاده نمود. چانفنگ^۲ [۲] توزیع فشار مغناطیسی در فرآیند انبساط استوانه را به صورت کیفی توسط نرم‌افزار ANSYS به صورت استاتیکی و متقارن محوری به دست آورد. اویورا^۳ [۳] با استفاده همزمان از دو نرم‌افزار ANSYS و LS-DYNA شکل دهنی یک ورق تخت را با قالبهای مختلف شبیه‌سازی نمود. آنگر^۴ [۴] یک فرمولیندی سه‌بعدی عمومی با در نظر گرفتن وابستگی میدانهای مغناطیسی، دما و تغییرشکل برای شبیه‌سازی مسائل شکل دهنی الکترومغناطیسی ارائه نمود. وانگ^۵ [۵] فرآیند شکل دهنی یک ورق تخت را با استفاده از رفتار شبه‌استاتیکی ماده توسط نرم‌افزار اجزاء محدود ADINA، به صورت متقارن محوری و دینامیکی گذرا، شبیه‌سازی نمود. چانفنگ^۶ [۶] نیز اثر فرکانس جریان را بر توزیع فشار مغناطیسی در فرآیند انقباض الکترومغناطیسی استوانه بررسی نمود. در کلیه شبیه‌سازی‌هایی که در خصوص کاربردهای مختلف فرآیند شکل دهنی الکترومغناطیسی انجام می‌شود، جریان الکتریکی جاری در سیمپیج به صورت تجربی اندازه‌گیری شده و به عنوان بار خارجی به مدل اجزاء محدود اعمال می‌گردد. لذا پارامترهای مداری دستگاه مانند ظرفیت بانک خازن و ولتاژ اولیه شارژ آن در این شبیه‌سازی‌ها وارد نمی‌شوند. بدین ترتیب، شبیه‌سازی امکان تعیین پارامترهای دستگاه را فراهم نمی‌کند.

از طرفی روابط تحلیلی مؤثری نیز برای این فرآیند توسعه پیدا نکرده‌اند. هدف از این تحقیق، ارائه الگوریتمی برای محاسبه بخش مؤثر پالس جریان الکتریکی دستگاه، در فرآیند شکل دهنی الکترومغناطیسی، است. الگوریتمی که در این مقاله ارائه می‌گردد، می‌تواند بر تحلیل عددی فرآیند شکل دهنی الکترومغناطیسی می‌باشد. در این روش ابتدا مقادیر اولیه‌ای برای ظرفیت بانک خازن، ولتاژ شارژ و فرکانس زاویه‌ای جریان حدس زده می‌شود. سپس با استفاده از شبیه‌سازی اجزاء محدود و یک حلقه تکرار محاسباتی، مقادیر دقیق پریود و ضریب خودالقائی معادل به دست می‌آید. بدین ترتیب، پالس جریان دستگاه محاسبه شده و می‌تواند در شبیه‌سازی فرآیند مورد استفاده

۱- Fenton

۲- Chunfeng

۳- Oliveira

۴- Unger

۵- Wang

۶- Chunfeng

معادلات (۱) و (۲) دستگاه معادلات کوبله را تشکیل می‌دهند. اگر تمام کمیت‌های موجود در دو معادله (۱) و (۲) مشخص باشند، می‌توان با تحلیل عددی این دستگاه معادلات، تغییرات جریان الکتریکی دستگاه و تغییرات جریان گردابی قطعه کار را به دست آورد. همانطور که ملاحظه می‌گردد، در این مدل مداری ساده‌سازی شده مشخصات مداری قطعه کار نیز به صورت متمرکز در نظر گرفته شده‌اند. برای اکثر قریب به اتفاق کاربردهای صنعتی، تعیین پارامترهای مداری متمرکز برای قطعه کار تقریباً غیر ممکن است. زیرا جریان گردابی به صورت پیوسته و غیر یکنواخت در قطعه کار توزیع می‌گردد و لذا بیان آن به صورت یک جریان مداری متمرکز یک بعدی می‌سر نیست. راهکار مناسبی که می‌توان برای حل این مشکل به کار برد، استفاده از مفهوم ضریب خودالقائی معادل سیم‌پیچ و قطعه کار است. به کار بردن ضریب خودالقائی معادل، به این معناست که فرض می‌شود مدار معادل دستگاه به صورت یک مدار مستقل از اثر القائی قطعه کار عمل می‌کند. اثر القائی قطعه کار بر روی جریان مدار دستگاه نیز با اصلاح ضریب خودالقائی مدار دستگاه لحظه‌ای گردد. لذا ضریب خودالقائی اصلی مدار دستگاه اصلاح می‌گردد و این ضریب خودالقائی اصلاح شده، ضریب خودالقائی معادل نامیده می‌شود. در این صورت معادله (۲) در تحلیل مداری در نظر گرفته نمی‌شود و معادله (۱) نیز به صورت معادله (۴) ساده می‌شود [۸].

$$I_1 R + L_{eq} \frac{dI_1}{dt} + V_C = 0 \quad (4)$$

معادله (۴) یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم بوده و به صورت تحلیلی قابل حل است. حل این معادله مطابق معادله (۵) می‌باشد.

$$I_1(t) = \frac{V_C e^{-\alpha t}}{L_{eq} \omega_d} \sin(\omega_d t) \quad (5)$$

$$\alpha = \frac{R}{2L_{eq}}, \quad R = R_o + R_1 \quad (6)$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2}, \quad \omega_o = \frac{1}{\sqrt{L_{eq} C}} \quad (7)$$

در معادلات (۵)، (۶) و (۷) سه پارامتر V_C ، L_{eq} و C که مشخص کننده مشخصات مداری اولیه دستگاه و نیز مشخصات هندسی سیم‌پیچ و قطعه کار هستند مستقیماً به جریان الکتریکی دستگاه مرتبط می‌شوند. لذا با مشخص بودن ضریب خودالقائی معادل و با استفاده از معادلات فوق، می‌توان پالس جریان دستگاه را به ازاء مقادیر مختلف V_C و C به دست آورده و در شبیه‌سازی فرآیند به کار برد.

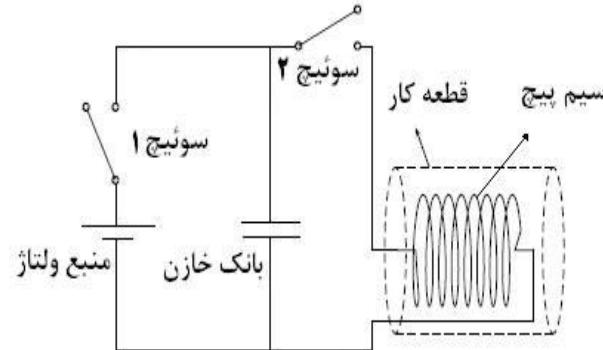
۲-۲- تحلیل مداری فرآیند

اولین گام در طراحی یک فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی، تعیین مشخصات مداری دستگاه مانند ظرفیت و ولتاژ اولیه بانک حازن و نیز ضریب خودالقائی سیم‌پیچ است. تحلیل مداری فرآیند، تنها روش ممکن برای استخراج پارامترهای مداری مورد نیاز برای دستگاه می‌باشد. به منظور تحلیل مداری فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی، دو مدار معادل ساده‌سازی شده، مطابق شکل ۲، برای دستگاه و قطعه کار در نظر گرفته می‌شود. در این مدل، مشخصات مداری دستگاه و قطعه کار به صورت متمرکز و ایده‌آل در نظر گرفته شده‌اند. این دو مدار روی یکدیگر اثر القائی متقابل دارند. با نوشتن قانون ولتاژ کیرشوف برای هر یک از دو مدار شکل ۲، به دو معادله (۱) و (۲) می‌رسیم:

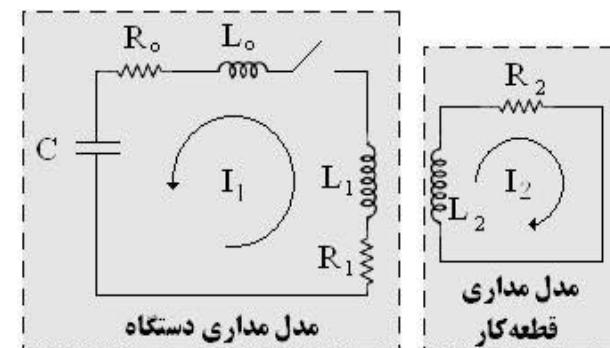
$$I_1 R + L \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} + V_C = 0 \quad (1)$$

$$I_2 R_2 + L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt} = 0 \quad (2)$$

$$L = L_o + L_1, \quad R = R_o + R_1 \quad (3)$$



شکل ۱- تجهیزات مورد استفاده در فرآیند انبساط الکترومغناطیسی استوانه فلزی.



شکل ۲- مدل مورد استفاده در تحلیل مداری فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی.

این پدیده به دلیل تأثیر قابل ملاحظه نیروهای ماند در تغییرشکل قطعه کار است و یکی از ویژگی های شاخص فرآیند شکل دهنده الکترومغناطیسی می باشد. وجود نیروهای ماند گاهی موجب می شود تا قطعه کار پس از میرا شدن پالس مغناطیسی و لذا از بین رفتن نیروهای الکترومغناطیسی نیز به تغییرشکل خود ادامه دهد. در مرجع [۱۱] نیز نتیجه مشابهی برای فرآیند انقباض استوانه، بر مبنای مشاهدات تجربی و محاسبات تحلیلی، به دست آمده است. اثر پیک های جریان دوم، سوم و ... در مقابل پیک اول قابل صرفنظر کردن است، به طوری که گاهی با قرار دادن دیود در مدار پس از پیک اول، جریان را میرا کرده و از پیک های بعدی صرفنظر می کنند. برای نمونه در مراجع [۲] و [۷] با قرار دادن دیود در مدار دستگاه، بانک خازن پس از یک چهارم پریود ابتدائی پالس جریان از مدار جدا شده و لذا از مابقی پالس جریان صرفنظر شده است. بنابراین در یک چهارم پریود ابتدائی پالس جریان در فرآیند شکل دهنده الکترومغناطیسی نیروهای مغناطیسی مؤثر بر قطعه کار اعمال می شوند، اما در این مدت زمان تغییرشکل قابل ملاحظه ای رخ نمی دهد. بخش عمدۀ تغییرشکل قطعه کار پس از این زمان، تحت اثر نیروهای ماند، ایجاد می گردد. لذا به منظور محاسبه پالس جریان دستگاه، لازم است تا یک چهارم پریود اول جریان، و به خصوص پیک اول جریان، با دقت قابل قبولی محاسبه گردد.

۴. محاسبه ضریب خودالقائی معادل

در این بخش، روش محاسبه ضریب خودالقائی معادل سیمپیج و قطعه کار شرح داده شده و میزان وابستگی این ضریب به فرکانس پالس جریان بررسی می گردد.

۴-۱- شبیه سازی اجزاء محدود

ضریب خودالقائی معادل را با استفاده از شبیه سازی اجزاء محدود محاسبه می نماییم. جزئیات مربوط به روش مورد استفاده در مرجع [۱۲] به طور کامل شرح داده شده است. مسئله ای که در این مقاله بررسی می شود، قبلاً به صورت تجربی در مرجع [۷] بررسی شده است. لذا تمامی اطلاعات هندسی و خواص مواد مربوط به سیمپیج و قطعه کار از مرجع [۷] استخراج شده است. جدول ۱ ابعاد هندسی و مشخصات مواد سیمپیج و قطعه کار را نشان می دهد.

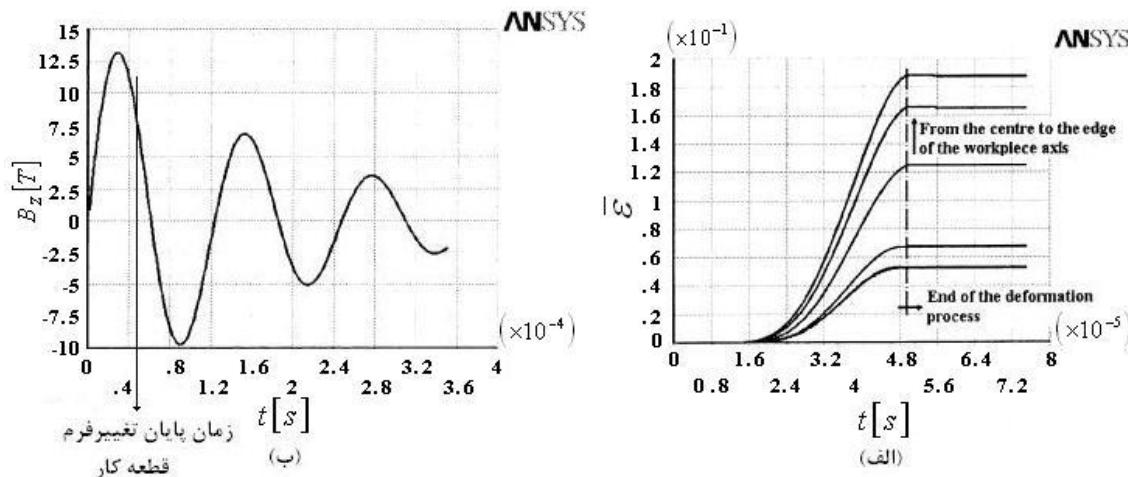
شکل ۴ مدل اجزاء محدود شبیه سازی سیمپیج و قطعه کار را نشان می دهد. شبیه سازی اجزاء محدود توسط نرم افزار ANSYS انجام شده است.

مقایسه دو معادله (۱) و (۴) نشان می دهد که عبارت $L_{eq} dI_1/dt$ جایگزین عبارت $L dI_1/dt + M dI_2/dt$ شده است. دو ضریب L و M تابع شکل هندسی سیمپیج و قطعه کار و نیز فرکانس جریان دستگاه هستند. جریان I_2 نیز تابع ضرایب M و L، فرکانس جریان دستگاه و مقاومت الکتریکی ویژه جنس قطعه کار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضریب L_{eq} تابع شکل هندسی سیمپیج و قطعه کار، مقاومت الکتریکی ویژه جنس قطعه کار و فرکانس جریان دستگاه خواهد بود.

۳. بررسی مکانیزم اعمال نیروی مغناطیسی

یکی از نکات حائز اهمیت در بررسی فرآیند شکل دهنده الکترومغناطیسی، تعیین مدت زمان اعمال نیروی مغناطیسی بر قطعه کار است. اهمیت این مسئله از آن جهت است که با تعیین بخش مؤثر پالس مغناطیسی، که نیروی مغناطیسی را بر قطعه کار اعمال می نماید، امکان بهینه سازی فرآیند و محافظت از بانک خازن دستگاه در مقابل جریان بازگشتی فراهم می گردد. این مسئله توسط محققین مختلف به صورت تجربی و محاسباتی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. برای نمونه، در مرجع [۹] نمودارهای تغییرات زمانی شدت پالس مغناطیسی سیمپیج و تغییرات کرنش معادل در قطعه کار، در فرآیند انقباض الکترومغناطیسی استوانه، توسط شبیه سازی اجزاء محدود به دست آمده است (شکل ۳).

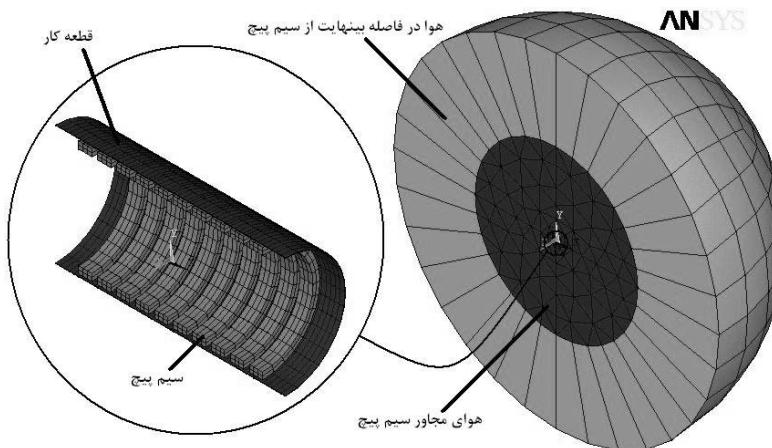
شکل ۳ (الف) نشان می دهد که تغییرشکل قطعه کار در مدت زمان حدود ۴۹ μs خاتمه می یابد. نمودار شکل ۳ (ب) نشان می دهد که این زمان در نیم پریود اول پالس مغناطیس قرار می گیرد. از قوانین مداری آمپر و القاء فاراده و نیز تعریف برداری نیروی لورنتس می توان نتیجه گرفت که جهت نیروی مغناطیسی وارد بر قطعه کار در یک چهارم پریود ابتدائی پالس مغناطیس به صورت دافعه و در یک چهارم پریود دوم پالس به صورت جاذبه می باشد. در مرجع [۱۰] با کاهش سرعت یک چهارم پریود اول پالس و افزایش سرعت یک چهارم پریود دوم آن در یک فرآیند شکل دهنده، قطعه کار به سمت سیمپیج جذب شده است. لذا می توان نتیجه گرفت که نیروهای مؤثر الکترومغناطیسی در یک چهارم پریود ابتدائی پالس جریان به قطعه کار اعمال می شوند. در نمودارهای شکل ۳ نیروهای دافعه ای مغناطیسی در مدت زمان ۳۰ μs به قطعه کار اعمال می شوند، اما این در حالیست که تغییرشکل قطعه کار تا زمان ۴۹ μs ادامه می یابد. نمودار شکل ۳ (الف) نشان می دهد که بخش عمدۀ تغییرشکل قطعه کار در فاصله زمانی ۳۰ μs تا ۴۹ μs (یعنی پس از خاتمه اعمال نیروهای دافعه ای) انجام شده است.



شکل ۳- (الف) تغییرات زمانی کرنش معادل در قطعه کار (ب) تغییرات زمانی شدت میدان مغناطیسی [۹].

جدول ۱- ابعاد هندسی و خواص مواد مربوط به سیم پیچ و قطعه کار (بر اساس داده های مرجع [۷]).

| فولاد | جنس | مشخصات قطعه کار |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| ۲۶ mm | شعاع میانگین | |
| .۰/۲ mm | ضخامت | |
| ۱۰۰ mm | طول | |
| $۱/۲۰ \times 10^{-8} \Omega m$ | مقاومت الکتریکی ویژه | |
| سیم | شار مغناطیسی اشباع | مشخصات سیم پیچ |
| ۱۰ | جنس | |
| ۲۲ mm | تعداد حلقه | |
| ۲۵ mm | شعاع داخلی | |
| ۸۰ mm | شعاع خارجی | |
| ۸/۲۵ mm | طول | |
| $۲/۶۳ \mu H$ | گام سیم پیچ | |
| $۱/۲۳۳ \times 10^{-5} \Omega$ | ضریب خودالقائی سیم پیچ خالی | |
| | مقاومت اهمی | |



شکل ۴- مدل اجزاء محدود سیم پیچ و قطعه کار.

که در این رابطه، ϕ_i ها مقادیر شار مغناطیسی در زمان‌های مختلف و I_i ها مقادیر جریان الکتریکی در زمان‌های مختلف هستند.

۴-۲- بررسی وابستگی ضریب خودالقائی معادل به فرکانس جریان

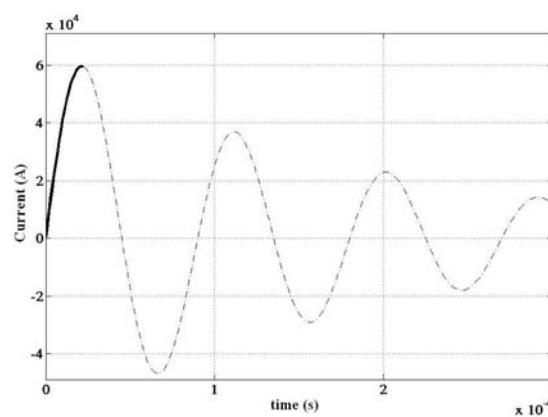
همانطور که قبلًا اشاره شد، ضریب خودالقائی معادل تابع شکل هندسی سیمپیج و قطعه‌کار، مقاومت الکتریکی ویژه جنس قطعه‌کار و فرکانس جریان الکتریکی سیمپیج است. در روشنی که در این مقاله و مرجع [۱۲] برای محاسبه ضریب خودالقائی معادل استفاده شده است، شکل هندسی سیمپیج و قطعه‌کار و نیز مقاومت الکتریکی ویژه قطعه‌کار به دقت در شبیه‌سازی در نظر گرفته می‌شود. لذا تنها پارامتر مؤثری که باید بررسی گردد، فرکانس جریان الکتریکی سیمپیج است. نمودار شکل ۶ ضرایب خودالقائی معادل را که با در نظر گرفتن فرکانس‌های مختلف برای جریان الکتریکی سیمپیج به دست آمده‌اند نشان می‌دهد.

نمودار شکل ۶ نشان می‌دهد که وابستگی ضریب خودالقائی به فرکانس جریان قابل ملاحظه است و باید در محاسبه این ضریب و نیز تعیین پارامترهای دستگاه مدنظر قرار گیرد. این در حالیست که در هنگام محاسبه ضریب خودالقائی معادل برای تعیین پارامترهای مورد نیاز دستگاه، فرکانس کاری دستگاه نامشخص است. لذا تنها روش ممکن، در نظر گرفتن یک حدس اولیه برای فرکانس جریان دستگاه و سپس اصلاح متوالی این حدس اولیه خواهد بود. این روش در ادامه توضیح داده خواهد شد.

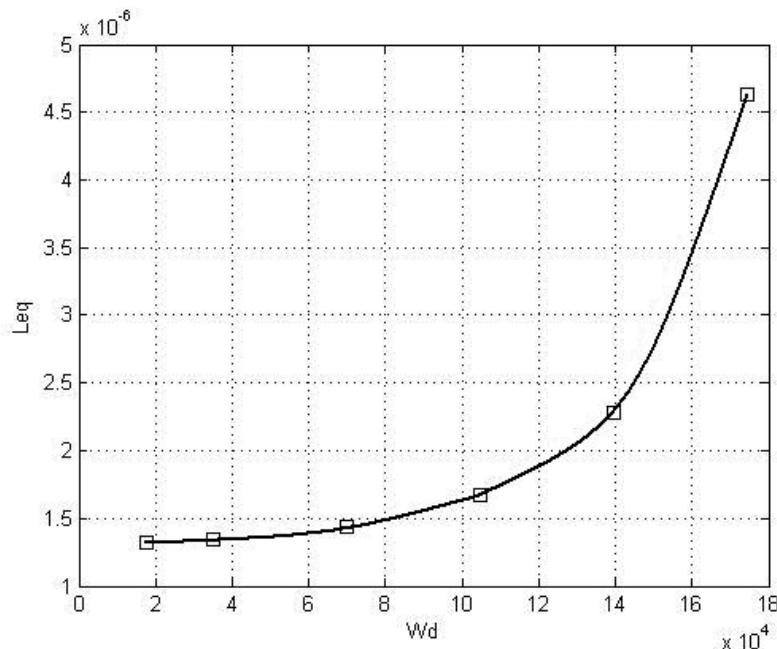
در این شبیه‌سازی، نیمی از مدل هندسی سیمپیج و قطعه‌کار در نظر گرفته شده و جریان الکتریکی به صورت یکتواخت بر روی مقطع برش خورده سیمپیج اعمال شده است. شرایط مرزی در کلیه سطوح خارجی مدل مطابق مرجع [۱۲] اعمال شده است. مطابق مرجع [۱۲] ابتدا برای اعتبار سنجی نتایج، سیمپیج بدون قطعه‌کار شبیه‌سازی شده و ضریب خودالقائی آن برابر $2/52 \mu H$ به دست آمد که با داده‌های جدول ۱ انطباق خوبی داشت. نمودار تغییرات جریان الکتریکی سیمپیج در شکل ۵ نشان داده شده است. قبل از اشاره شد که نتایج شبیه‌سازی‌ها و بررسی‌های تجربی نشان داده است که نیروی مؤثر مغناطیسی در یک چهارم از پریود ابتدائی پالس جریان به قطعه‌کار وارد می‌شود. به علاوه، بخش عمدۀ ای از تغییرشکل قطعه‌کار نیز پس از یک چهارم از پریود ابتدائی پالس جریان ایجاد می‌گردد. به همین جهت در اینجا تنها یک چهارم از اولین پریود جریان در شبیه‌سازی در نظر گرفته شده است.

پس از تحلیل اجزاء محدود تغییرات شدت میدان مغناطیسی توسط نرم‌افزار، تغییرات شار مغناطیسی در ازاء مقادیر مختلف جریان به دست می‌آید. سپس مطابق مرجع [۱۲] با استفاده از روش حداقل‌سازی مربعات می‌توان ضریب خودالقائی معادل سیمپیج و قطعه‌کار را توسط رابطه (۸) به دست آورد.

$$L_{eq} = \frac{\sum_i \phi_i}{\sum_i I_i} \quad (8)$$



شکل ۵- نمونه‌ای از نمودار جریان مورد استفاده در بارگذاری سیمپیج.
(بخشی از نمودار که با خط پررنگ رسم شده، در بارگذاری سیمپیج به کار رفته است)



شکل ۶- ضرائب خودالقائی معادل محاسبه شده به ازاء فرکانس‌های مختلف

نامعلوم است، یک حدس اولیه دلخواه $\omega_d = 104600$ (rad/sec) را در نظر می‌گیریم. سپس با استفاده از معادله (۵)، یک پالس سینوسی میرا شونده با فرکانس $\omega_d = 104600$ (rad/sec) و ولتاژ اولیه دلخواه را در تحلیل اجزاء محدود به عنوان بار خارجی به مدل سیمپیج اعمال می‌نمائیم. همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است، در این شبیه‌سازی تنها یک چهارم پریود ابتدائی از پالس جریان در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، با استفاده از نتایج شبیه‌سازی، مقدار اولیه غیر دقیقی برای ضریب خودالقائی معادل (L_{eq}) به دست می‌آید. سپس این ضریب در روابط (۶) و (۷) قرار داده شده و مقدار جدیدی برای ω_d به دست می‌آید. مجدداً مقدار جدید ω_d در شبیه‌سازی وارد شده و مقدار اصلاح شده‌ای برای L_{eq} به دست می‌آید. این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که مقادیر L_{eq} و ω_d همگرا شوند. شکل‌های ۷ و ۸ به ترتیب دونمودار مربوط به همگرایی مقادیر ω_d و L_{eq} را نشان می‌دهند.

جدول ۲- مشخصات مداری دستگاه [۷]

| مقادیر تجربی | پارامتر |
|----------------|---------|
| $215(\mu H)$ | L_0 |
| $15(m\Omega)$ | R_0 |
| $60/25(\mu F)$ | C |
| $14(kV)$ | V_C |

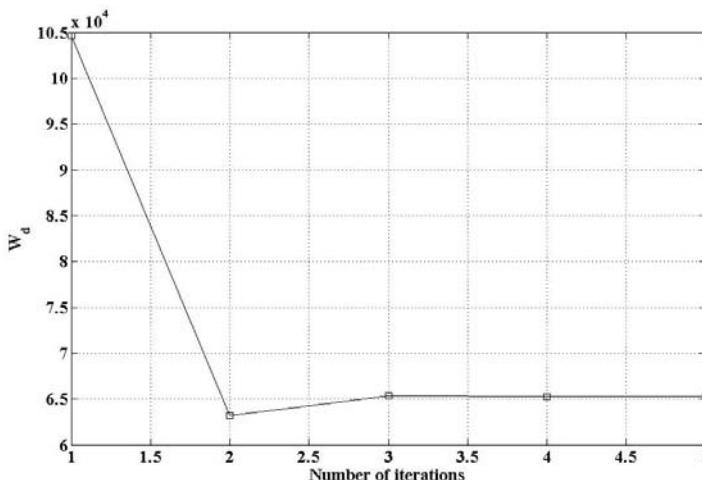
۵. تعیین پارامترهای فرآیند

در اینجا ابتدا مشخصات بانک خازن در یک فرآیند انبساط استوانه با پارامترهای معلوم، که اطلاعات تجربی آن در مراجع موجود است، تعیین می‌شود. سپس روش مورد استفاده گسترش داده شده و یک الگوریتم عمومی جهت تعیین پارامترهای فرآیند ارائه می‌گردد.

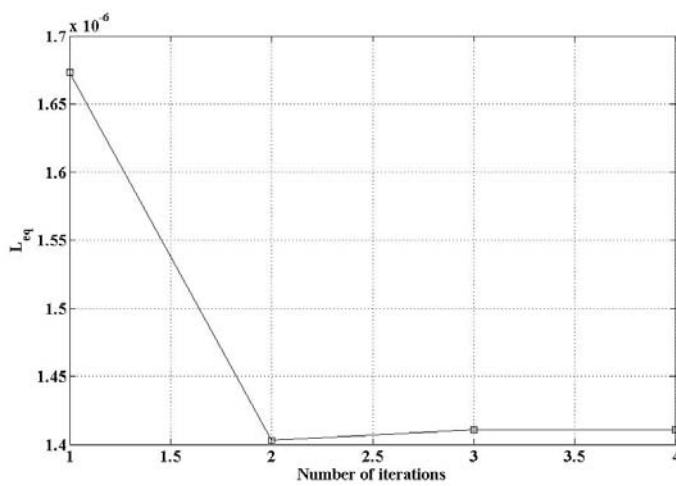
۵-۱- تعیین پارامترهای بانک خازن و مقایسه با نتایج تجربی

در این قسمت، بر اساس اطلاعات مربوط به تست تجربی که در مرجع [۷] ارائه شده است، ضریب خودالقائی معادل سیمپیج و قطعه‌کار محاسبه می‌شود. سپس به منظور اعتبار سنجی نتایج، با استفاده از داده‌های مربوط به مشخصات مداری دستگاه، ظرفیت و ولتاژ اولیه شارژ بانک خازن، پالس جریان الکتریکی دستگاه تخمین زده می‌شود. نتیجه حاصله با پالس جریان الکتریکی که به صورت تجربی اندازه‌گیری شده، مورد مقایسه قرار می‌گیرد. جدول ۲ ضریب خودالقائی و مقاومت اهمی معادل دستگاه را نشان می‌دهد.

همانطور که قبلاً اشاره شده، در محاسبه ضریب خودالقائی معادل سیمپیج و قطعه‌کار، سه عامل شکل هندسی سیمپیج و قطعه کار، مقاومت الکتریکی ویژه قطعه کار و فرکانس جریان دستگاه تأثیر عمدتای دارند. دو عامل شکل هندسی و مقاومت الکتریکی ویژه قطعه کار در شبیه‌سازی اجزاء محدود در نظر گرفته می‌شوند. برای وارد نمودن اثر فرکانس جریان دستگاه که در ابتدای



شکل ۷- روند همگرایی فرکانس زاویه‌ای (ω_d)

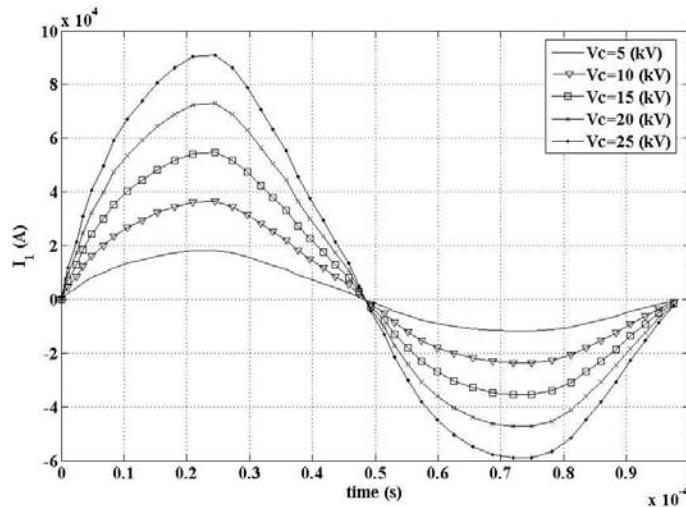


شکل ۸- روند همگرایی ضریب خودالقائی معادل (L_{eq})

پارامتر ω_d و L_{eq} نیست و فقط با تغییر مقدار V_C می‌توان منحنی‌های مختلف مربوط به پالس‌های جریان را به دست آورد. شکل ۹ نمودارهای مختلف مربوط به پالس جریان با ولتاژهای مختلف را نشان می‌دهد. همانطور که اشاره شد، به منظور اعتبارسنجی نتایج حاصله، پالس جریان برآورده شده به ازاء $C = 60/25 \mu F$ و $V_c = 14 kV$ را با پالس جریانی که به صورت تجربی در مرجع [۷] اندازه‌گیری شده است مقایسه می‌کنیم. شکل ۱۰ مقایسه دو نمودار را نشان می‌دهد.

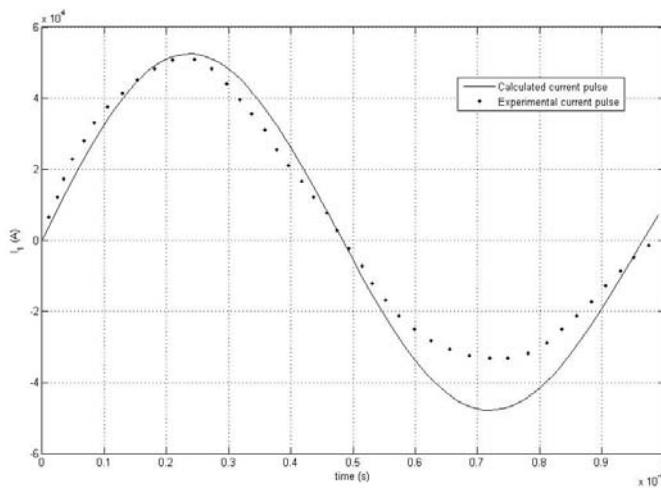
شکل ۱۰ نشان می‌دهد که پالس جریان حاصل از محاسبات و پالس جریان اندازه‌گیری شده در مرجع [۷] در نیم پریود اول انطباق قابل قبولی با هم دارند.

دو نمودار شکل‌های ۷ و ۸ به ترتیب مقادیر $\omega_d = 65583 \text{ rad/sec}$ و $L_{eq} = 1/418 \mu H$ را به دست می‌دهند. اکنون با استفاده از این مقادیر و داده‌های جدول ۲ می‌توان توسط معادله (۵)، پالس جریان الکتریکی دستگاه را برآورد نمود. روابط (۶) و (۷) نشان می‌دهند که مقدار ω_d وابستگی زیادی به ظرفیت خازن دارد. قبل اشاره شد که مقدار L_{eq} نیز به مقدار ω_d وابسته است. لذا چنانچه بخواهیم پالس جریان را به ازاء مقدار جدید ظرفیت خازن به دست آوریم، باید مجدد ω_d و L_{eq} را با روندی که در این قسمت شرح داده شد محاسبه نماییم. اما مقادیر این دو پارامتر به ولتاژ شارژ بانک خازن وابسته نیست. لذا چنانچه بخواهیم پالس جریان دستگاه به ازاء ولتاژهای مختلف برای بانک خازن به دست آید، نیازی به محاسبه مجدد دو



شکل ۹- پالس های جریان دستگاه به ازاء ولتاژهای مختلف بانک خازن.

$$(L_{eq} = 1/418 \mu H \text{ و } C = 60/25 \mu F)$$



شکل ۱۰- مقایسه پالس جریان محاسبه شده با پالس اندازه گیری شده در مرجع [۷].

شبیه سازی به دلیل در نظر نگرفتن این تغییر شکل، خطای زیادی پیدا می کند. همچنین ملاحظه می شود که پریود زمانی پالس واقعی برابر $(\mu s) ۹۷/۶$ اندازه گیری شده، در حالیکه در محاسبات پریود برابر $(\mu s) ۹۶/۵$ به دست آمده است. لذا پریود زمانی با خطای $۱/۱\%$ محاسبه شده است. ماکریتم دامنه جریان در پالس واقعی برابر $(A) ۱۰/۵$ و در پالس محاسبه شده برابر $(A) ۱۰/۵ \times ۲۵/۵$ می باشد. بنابراین ماکریتم دامنه جریان نیز با خطای $۲/۹\%$ محاسبه شده است. ماکریتم دامنه جریان یکی از مهمترین و تأثیر گذارترین کمیت ها در میزان

قبلأً اشاره شد (شکل ۲) که یک چهارم پریود اول پالس جریان سیم پیج در اعمال نیروی مغناطیسی به قطعه کار مؤثر است. همانطور که قبلأً ذکر شد، در فرآیند شکل دهی الکترومغناطیسی، بخش اعظم تغییر شکل قطعه کار پس از یک چهارم پریود اول پالس جریان ایجاد می شود. در شبیه سازی اجزاء محدود برای محاسبه ضریب خودالقائی معادل نیز، تنها یک چهارم از پالس جریان به سیم پیج اعمال شد. از آنجا که در این شبیه سازی از تغییر شکل قطعه کار صرف نظر شده است، لذا نتایج حاصل از این تحلیل در نیم پریود اول، دقیق بالایی دارد. در نیم پریود دوم که قطعه تغییر شکل زیادی دارد، نتایج

خازن وابسته هستند. برای تغییر دادن مشخصات سیم‌پیچ نیز باید کل پروسه شبیه‌سازی و محاسبات را از ابتدا با در نظر گرفتن شکل هندسی جدید سیم‌پیچ تکرار نمود. اثرات مربوط به تغییر در هر یک از سه پارامتر فوق را می‌توان به صورت زیر جمع‌بندی نمود.

تغییرات ولتاژ اولیه شارژ بانک خازن:

افزایش ولتاژ، انرژی اولیه ذخیره شده در بانک خازن را افزایش داده، دامنه پالس جریان را به صورت مستقیم افزایش می‌دهد و در فرکانس پالس جریان تأثیری ندارد. لذا افزایش ولتاژ سبب افزایش نیروهای مغناطیسی و لذا افزایش میزان تغییرشکل قطعه‌کار می‌گردد. اما تجهیزاتی مانند بانک خازن، سوئیچ‌های تخلیه . . . دارای دامنه ولتاژ و جریان کاری معینی هستند و لذا ولتاژ ناید از حد قابل تحمل این تجهیزات بیشتر شود.

تغییرات ظرفیت بانک خازن:

افزایش ظرفیت بانک خازن (با فرض ثابت باقی ماندن ولتاژ) انرژی ذخیره شده اولیه را افزایش داده، سبب افزایش دامنه پالس جریان شده (البته تأثیر آن کمتر از اثر ولتاژ است) و همچنین فرکانس پالس جریان را نیز کاهش می‌دهد. با کاهش فرکانس جریان، نیروهای مغناطیسی تا حدودی کاهش می‌یابند. لذا افزایش ظرفیت بانک خازن از طرفی باعث افزایش دامنه جریان و نیروهای مغناطیسی و از طرف دیگر موجب کاهش فرکانس جریان و کاهش نیروهای مغناطیسی می‌گردد. بنابراین اثر افزایش ظرفیت بانک خارن بر کاهش و یا افزایش تغییرشکل قطعه‌کار را باید با انجام محاسبات و شبیه‌سازی مشخص نمود.

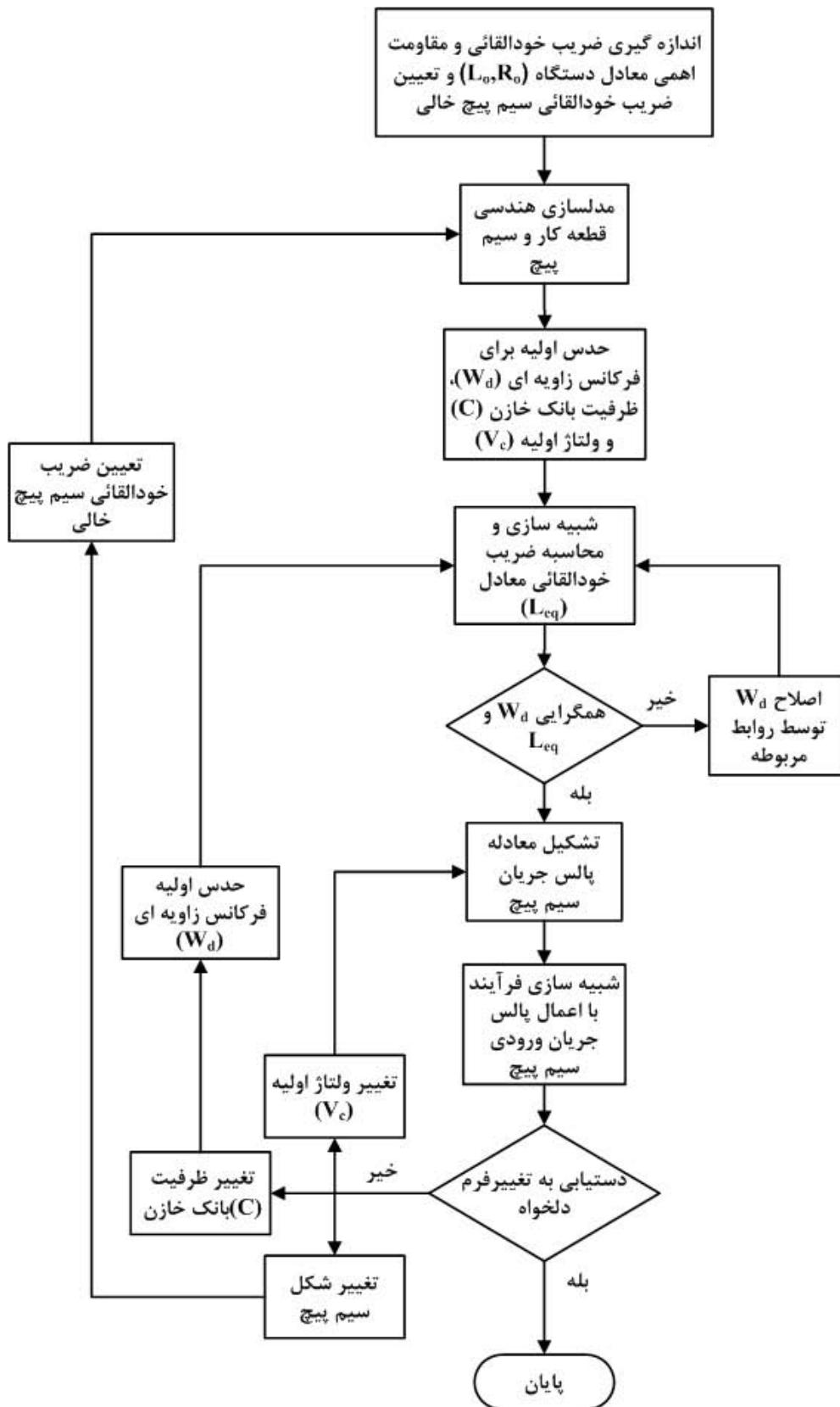
تغییرات شکل هندسی و تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ:

تغییرات شکل هندسی سیم‌پیچ سبب تغییر ضریب خودالقائی معادل آن خواهد شد. به ویژه افزایش تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ موجب افزایش ضریب خودالقائی معادل می‌گردد. با افزایش ضریب خودالقائی معادل، فرکانس جریان کاهش یافته و دامنه جریان نیز کاهش می‌یابد. این دو عامل سبب کاهش نیروهای مغناطیسی می‌شود. اما از طرف دیگر افزایش ضریب خودالقائی معادل موجب افزایش شدت میدان مغناطیسی و لذا افزایش نیروهای مغناطیسی نیز می‌گردد. بنابراین با توجه به پیچیدگی‌های موجود، اثر حاصل از تغییر شکل هندسی سیم‌پیچ بر افزایش یا کاهش میزان تغییرشکل قطعه‌کار را باید با انجام محاسبات و شبیه‌سازی تعیین نمود. روند کلی انجام محاسبات و شبیه‌سازی‌ها و چگونگی ایجاد تغییر در سه پارامتر یاد شده، در فلوچارت شکل ۱۱ نشان داده شده است.

تغییرشکل است، زیرا مستقیماً مقدار ماکریزم دامنه تغییرات شدت میدان مغناطیسی را مشخص می‌کند. در مرجع [۱۳] فشار وارد بر قطعه‌کار در فرآیند انقباض استوانه، تنها با استفاده از مقدار ماکریزم شدت میدان مغناطیسی، محاسبه شده و در یک شبیه‌سازی استاتیکی به کار رفته است. نتایج به دست آمده نیز هم‌خوانی خوبی با اندازه‌گیری‌های تجربی داشته‌اند. بنابراین محاسبه دامنه جریان با خطای ۲/۹٪ نشان دهنده دقت قابل قبول نتایج است. لذا پالس جریان در ناحیه مؤثر آن با دقت قابل قبولی محاسبه شده است.

۵-۲- الگوریتم پیشنهادی برای تعیین پارامترهای سیم‌پیچ و بانک خازن

در قسمت قبل ملاحظه گردید که توسط شبیه‌سازی اجزاء محدود و با استفاده از حدس اولیه برای فرکانس زاویه‌ای پالس جریان، می‌توان در حلقه تکرار محاسباتی به مقادیر قابل قبولی برای فرکانس واقعی جریان و ضریب خودالقائی معادل دست یافت. با استفاده از این مقادیر می‌توان نیم‌پریود اول پالس جریان را محاسبه نمود. این پالس جریان محاسبه شده در شبیه‌سازی تغییرشکل قطعه‌کار به عنوان بار خارجی به سیم‌پیچ اعمال شده و میزان تغییرشکل به دست می‌آید. در مرجع [۱۴] یک روش شبیه‌سازی اجزاء محدود جهت تعیین میزان تغییرشکل قطعه‌کار در فرآیند شکل‌دهی الکترومغناطیسی ارائه شده است. در این روش، پالس جریان الکتریکی به عنوان بار خارجی به سیم‌پیچ اعمال شده است. سه پارامتر اصلی که برای کنترل پالس جریان در اختیار طراح فرآیند قرار دارند، عبارتند از ولتاژ اولیه شارژ بانک خازن، ظرفیت بانک خازن و شکل‌هندسی و تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ. لذا چنانچه پالس جریانی که با مقادیر اولیه در نظر گرفته شده برای این سه پارامتر به دست می‌آید، تغییرشکل دلخواه را در قطعه‌کار ایجاد ننماید، باید با تغییر یک یا تعداد بیشتری از این سه پارامتر، پالس جریان را اصلاح نمود. ساده‌ترین روش برای اصلاح پالس جریان، تغییر ولتاژ اولیه بانک خازن است. زیرا تغییر دامنه پالس جریان می‌شود. اما باید توجه نمود که افزایش ولتاژ به دلیل ملاحظات ایمنی کاربر و نیز محدودیت شرایط عملکردی تجهیزات دستگاه، دارای محدودیت‌هایی است. در صورتی که نتوان با تغییرات ولتاژ به تغییر شکل مورد نظر رسید، باید یکی از دو پارامتر دیگر را تغییر داد. این در حالیست که تغییر دادن ظرفیت بانک خازن مستلزم مسازی مجدد فرکانس زاویه‌ای و ضریب خودالقائی معادل است. زیرا این دو کمیت به ظرفیت بانک



شكل ۱۱- الگوريتم تعين پارامترهاي بانک خازن و سيم پيج در فرآيند شكلدهي الکترومغناطيسي

- [2]. Chunfeng, L.; Zhiheng, Z.; Jianhui, L.; Yongzhi, W.; Yuying, Y. "Numerical Simulation of the Magnetic Pressure in Tube Electromagnetic Bulging"; J. Mat. Proc. Tech. 123, Elsevier, 225–228, 2002.
- [3]. Oliveira, D. A.; Worswick, M. J.; Finn, M.; Newman, D. "Electromagnetic Forming of Aluminum Alloy Sheet: Free-Form and Cavity Fill Experiments and Model"; J. Mat. Proc. Tech. 170, Elsevier, 350–362, 2005.
- [4] Unger, J.; Stiemer, M.; Svendsen, B.; Blum, H. "Multifield Modeling of Electromagnetic Metal Forming Processes"; J. Mat. Proc. Tech. 177, Elsevier, 270–273, 2006.
- [5]. Wang, L.; Chen, Z. Y.; Li, C. X.; Huang, S. Y. "Numerical Simulation of the Electromagnetic Sheet Metal Bulging Process"; Int. J. Adv. Manuf. Tech. 30, Springer-Verlag, 395–400, 2006.
- [6]. Haiping, Y. U.; Chunfeng, L.I. "Effects of Current Frequency on Electromagnetic Tube Compression"; Accepted to be published in J. Mat. Proc. Tech., 2008.
- [7]. Motoaşcă, T.E. "Electrodynamics in deformable solids for electromagnetic forming"; Ph.D. Thesis, Delft university of Technology, 2003.
- [8]. Hayt, W. H.; Kemmerly, JR. J. E. "Engineering Circuit Analysis"; Mc Graw-Hill, 5th ed., N.Y., 1993.
- [9]. Mamalis, A. G.; Manolakos, D. E.; Kladas, A. G.; Koumoutsos, A. K. "Physical Principles of Electromagnetic Forming Process: A Constitutive Finite Element Model"; J. Mat. Proc. Tech. 161, Elsevier, 294–299, 2005.
- [10]. Deng, J.; Li, C.; Zhao, Z.; Tu, F.; Yu, H. "Numerical Simulation of Magnetic Flux and Force in Electromagnetic Forming with Attractive Force"; J. Mat. Proc. Tech. 184, Elsevier, 190–194, 2007.
- [11]. Bednarski, T. "Magnetic Reducing of Thin-Walled Tubes" in: proceedings of the Third seminar on Metal Forming, Gyor, Hungary, 1985.
- [12]. صدیقی, م., خاندائی, م., لیاقت, م. ع. "محاسبه عددی ضرب خودالقائی معادل سیم پیچ در فرآیند انبساط الکترومغناطیسی استوانه", مجله علمی- پژوهشی علوم دانشگاه شهید چمران اهواز, شماره ۱۸, قسمت الف, ص ۱۰۰-۸۶, زمستان ۱۳۸۶.
- [13]. Murakoshi, Y.; Takahashi, M.; Sano, T.; Hanada, K.; Negishi, H. "Inside Bead Forming of Aluminum Tube by Electro-Magnetic Forming"; J. Mat. Proc. Tech. 80-81, ELSEVIER, 695-699, 1998.
- [14]. صدیقی, م., لیاقت, م. ع., خاندائی, م., "مبانی تئوری شکل دهنی الکترومغناطیسی و تحلیل عددی- تجربی فرآیند انقباض استوانه", نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران, شماره پیاپی ۱۳, ص ۴۶-۲۹, آذر ۱۳۸۷.

۶. نتیجه گیری

نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهد که با در نظر گرفتن مفهوم ضرب خودالقائی معادل می توان یک چهارم پریود ابتدائی پالس جریان دستگاه را، که بخش مهم و تأثیر گذار این پالس می باشد، با دقت قابل قبول پیش بینی نمود. همچنین با استفاده از نتایج شبیه سازی اجزاء محدود در حلقه تکرار محاسباتی، کلیه پارامترهای مؤثر در ضرب خودالقائی معادل سیم پیچ و استوانه در محاسبه این ضرب در نظر گرفته شد. مقادیر فرکانس زاویه ای و ضرب خودالقائی معادل که از حلقه تکرار به دست آمده اند، نرخ همگرایی بسیار بالایی دارند. الگوریتم ارائه شده نیز چگونگی اعمال اثر تغییرات سه پارامتر مهم ظرفیت خازن، ولتاژ اولیه و شکل هندسی سیم پیچ را در محاسبه بخش مؤثر پالس جریان نشان می دهد و می تواند برای تعیین پارامترهای مناسب فرآیند مورد استفاده قرار گیرد.

۷. لیست علائم و نشانه ها

t : زمان

B : شار مغناطیسی

\bar{E} : کرنش معادل

I_1 : جریان الکتریکی در دستگاه

I_2 : جریان الکتریکی در قطعه کار

C : ظرفیت بانک خازن

M : ضرب القاء متقابل

R_o : مقاومت اهمی مدار دستگاه

R_1 : مقاومت اهمی سیم پیچ

L_2 : ضرب خودالقائی قطعه کار

R_2 : مقاومت اهمی در قطعه کار

L_{eq} : ضرب خودالقائی معادل سیم پیچ و قطعه کار

V_C : ولتاژ شارژ بانک خازن

O_d : فرکانس زاویه ای پالس جریان دستگاه

L_o : ضرب خودالقائی مدار دستگاه

ϕ : شار مغناطیسی در سطح داخلی سیم پیچ

۸. مراجع

- [1]. Fenton, G. K.; Daehn, G. S. "Modeling of Electromagnetically Formed Sheet Metal"; J. Mat. Proc. Tech. 75, Elsevier, 6–16, 1998.